

蒸发源及控制器

Evaporator and Controller

**EBE35A、RHE35A、
EBC103、MTC110**



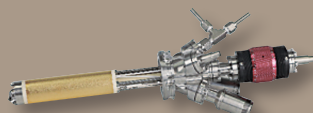
电子束蒸发源控制器
E-beam Controller



多功能温度控制器
Multifunction Temperature Controller



电阻加热蒸发源
Resistance-Heated Evaporator



电子束蒸发源
E-beam Evaporator

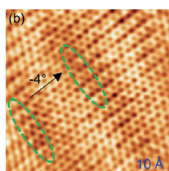
性能指标

- 电阻加热蒸发源—适用材料：有机分子 / 低温金属；工作温度范围：350 °C—1300 °C；坩埚类型：Al₂O₃/BN/ 石墨 / 金属；坩埚容积：1 cc；控温精度：±0.1 °C
- 大坩埚电阻加热蒸发源—适用材料：有机分子 / 低温金属；工作温度范围：350 °C—1500 °C；坩埚类型：Al₂O₃/BN/ 石墨；坩埚容积：7 cc；控温精度：±0.1 °C
- 低温电阻加热蒸发源—适用材料：有机分子；工作温度范围：100 °C—350 °C；坩埚类型：Al₂O₃/BN/ 石墨；坩埚容积：7 cc；控温精度：±0.05 °C
- 电子束加热蒸发源—适用材料：半导体 / 高温金属；坩埚类型：W/Ta/ 石墨 / Mo；源数量：1；最高工作温度范围：≥ 3000 °C；束流控制精度：±5%。
- 多功能温度控制器—输入电压：220 VAC；输出电压：0—40 V；输出电流：0—20 A；控温精度：±0.1 °C。
- 电子束加热控制器—高压源：0—2000 V；0—125 mA；束流检测范围：100 pA—1 mA；灯丝电流：0—5 A；束流最佳控制精度：5%

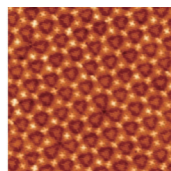
主要应用

表面科学、超薄膜层、有机分子层、
掺杂、分子束外延生长

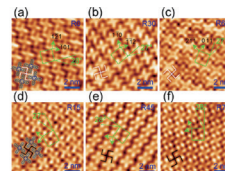
代表性应用成果



固态碳源石墨烯



分子原子自组装



有机分子薄膜制备

主要用户单位	清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学、中国科学院物理研究所、中国科学院国家纳米科学中心、中国科技大学、中国科学院大学、匹兹堡大学、加州大学 Irvine 分校、IBM 实验室、伊利诺伊大学芝加哥分校、法国 CEA
研制单位	中国科学院物理研究所
联系方式	邹老师 010-82649096, 18910279533 huanq@iphy.ac.cn